

平成23年11月吉日

各位

「クラスターイオンビームテクノロジー」に関する
第11回国際ワークショップ開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、下記において第11回目となる国際ワークショップを開催いたします。国内外の第一線の研究者が参集し、基礎から産業展開にいたる最新の研究成果について講演と討論・意見交換を行うこととなりました。皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

記

1. 開催期日

日時 : 2011年12月5日(月)

講演: 10:30 ~ 17:15(予定) / 懇親会: 17:45 ~ 19:30(予定)

場所 : 京都大学 東京オフィス 会議室2、3(講演)、会議室1(懇親会)

〒108-6027 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟27階

(アクセス: <http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/tokyo-office/about/access.htm>)

東海道新幹線、JR・京浜急行「品川駅」下車 徒歩5分

2. トピック

- ・ クラスター-固体表面相互作用の基礎理論
- ・ 原子構造体の配向・配列制御
- ・ クラスターイオンビーム装置の開発
- ・ クラスターイオンビームの新しい応用
- ・ 原子構造体の検出と構造解析
- ・ 原子構造体を利用する新しいプロセス技術

3. プログラム概要 12月5日(月)

- 10:00 **Registration**
- 10:30 **Opening remarks**
- 10:35 **Michael Dürr** (Hochschule Esslingen, University of Natural Sciences)
“Soft cluster-induced desorption and ionization of biomolecules for application in mass spectrometry”
- 11:15 **Noriaki Sanada** (ULVAC-PHI, Inc.)
“Recent Applications of GCIB with XPS and TOF-SIMS”
- 11:40 **Toshio Seki** (Kyoto University)
“The Effect of Size Variation in Sputtering with Size-Selected Cluster Ion Beams”
- 12:05 **Noriaki Toyoda** (University of Hyogo)
“What is the key parameter of electron ionization on crater formations on solid surface ?”
- 12:30 **Lunch**
- 14:00 **Shinji Matsui** (University of Hyogo)
“Three-Dimensional Nanostructure Fabrication by Focused-Ion-Beam Chemical Vapor Deposition”
- 14:40 **Hideki Sato** (Nachi-Fujikoshi Corp.)
“Improvement on Imprint Mold Release with Gas Cluster Ion Beam”
- 15:05 **Yu Yoshino** (Iwatani Corporation)
“Characteristics of Si Etching Using ClF₃-Ar Cluster Beam”
- 15:30 **Break**
- 15:55 **Masayasu Tanjo** (Nissin Ion Equipment Co.,Ltd.)
“Cluster Ion Implantation for Semiconductor Materials”
- 16:20 **Kenichi Hara** (Tokyo Electron Ltd.)
“Cu etching using O₂-GCIB under acetic acid gas atmosphere”
- 16:45 **Takaaki Aoki** (Kyoto University)
“Molecular dynamics simulations of large fluorine cluster impact on silicon with supersonic velocity”
- 17:05 **Closing remarks**
- 17:45 **Banquet** (品川インターシティ SHOP&RESTAURANT 棟 4F)

4. 参加登録

ホームページ: <http://clusterion.jp/workshop/index.htm> からお申し込み下さい。

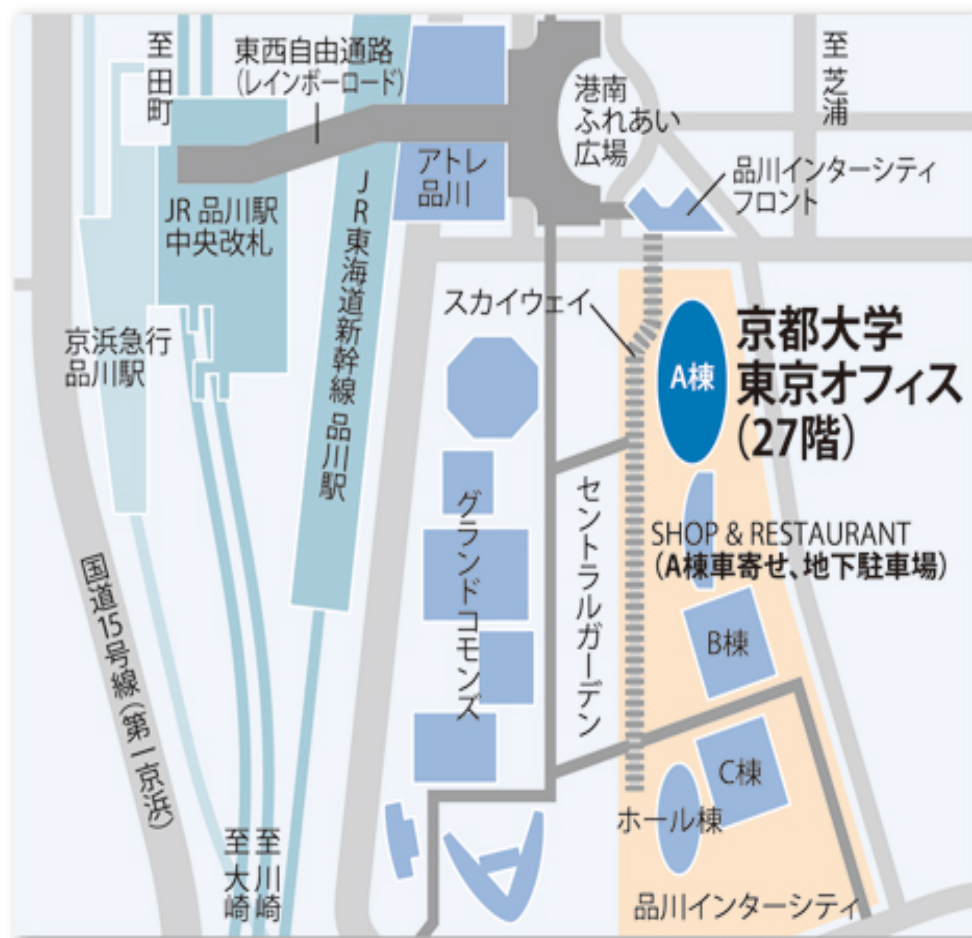
または、下記メールアドレス宛に、お名前、ご所属機関、ご住所、TEL、懇親会への参加有無を記載の上、送信頂いても結構でございます。当日の参加申込も可能です。

参加申込みメールアドレス: mogami@sakura.nucleng.kyoto-u.ac.jp

(受付締切日:2011/12/2(金)17時)

会場案内図

※京都大学 東京オフィスとなりますので、ご注意ください。



品川駅・東西自由通路（レインボーロード）からは品川インターシティ A 棟の 2 階に入ります。
エスカレーターで 3 階までお上がりの上、高層階行きエレベータで 27 階にお越してください。